

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和1年11月14日(2019.11.14)

【公開番号】特開2019-148825(P2019-148825A)

【公開日】令和1年9月5日(2019.9.5)

【年通号数】公開・登録公報2019-036

【出願番号】特願2019-92552(P2019-92552)

【国際特許分類】

G 03 F 7/20 (2006.01)

G 03 F 9/00 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/20 5 0 5

G 03 F 9/00 A

【手続補正書】

【提出日】令和1年10月1日(2019.10.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0064

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0064】

なお、一例として、各描画ラインS L 1～S L 6の実効的な長さ(描画長)を30mmとし、実効的なサイズが3μmのスポット光S Pの1/2ずつ、つまり、1.5(=3×1/2)μmずつ、オーバーラップさせながらスポット光S Pを描画ラインS L n(S L 1～S L 6)に沿って基板Pの被照射面上に照射する場合、パルス状のスポット光S Pは、1.5μmの間隔で照射される。したがって、1回の走査で照射されるスポット光S Pの数は、20000(=30[m m]/1.5[μm])となる。また、基板Pの副走査方向の送り速度(搬送速度)V tを2.42mm/secとし、副走査方向についてもスポット光S Pの走査が1.5μmの間隔で行われるものとすると、描画ラインS L nに沿った1回の走査開始(描画開始)時点と次の走査開始時点との時間差(周期)T p xは、約620μsec(=1.5[μm]/2.42[mm/sec])となる。この時間差T p xは、8反射面R PのポリゴンミラーPMが1面分(45度=360度/8)だけ回転する時間である。この場合、ポリゴンミラーPMの1回転の時間が、約4.96ms sec(=8×620[μsec])となるように設定される必要があるので、ポリゴンミラーPMの回転速度V pは、毎秒約201.613回転(=1/4.96[ms sec])、すなわち、約12096.8rpmに設定される。